表面ポテンシャル揺らぎが GaN MOSFET のキャリア移動度に与える影響

Impacts of surface potential fluctuation on carrier mobility in an inversion layer of GaN MOSFET

産総研 GaN-OIL, ^O田岡 紀之, 山田寿一, 清水三聡 AIST GaN-OIL, [°]N. Taoka, T. Yamada, and M. Shimizu E-mail: taoka-nori@aist.go.jp

【背景】反転層中のキャリア移動度は、MOSFET の特性を表す重要な指標である。そのため反転 層中におけるキャリアの散乱機構の解明は移動 度を向上させる為に非常に重要である。 Poly-Si/SiO₂/Si構造のMOSFETでは、その散乱機 構は良く理解されているが[1]、GaN MOSFETで は、その理解は不十分である。また、GaN MOS 界面では、非常に大きな表面ポテンシャル揺ら ぎ(σ_s)が見られているが[2]、 σ_s が移動度に与え る影響については、ほとんど議論されていない。 そこで本研究では、 σ_s と界面準位の性質が移動 度に及ぼす影響について Brews のモデル[3]を基 に検討した。

【計算方法】GaN 表面におけるフェルミレベル (E_{SF})、界面電荷量(N_{it})および σ_s との関係を Brews のモデルを用いて計算した。計算では、 N_{it} は E_{SF} に依存せず一定とした。このことは同数のアク セプタとドナー型の界面準位がバンドギャップ



Fig. 1: σ_s as functions of (a) energy from E_c and (b) N_s . Here, E_c denotes the energy level of the conduction band minimum.

中に分布している状態、または、固定電荷が支配的な状態に相当する。また、反転層キャリア密度(N_s)の*E*_{SF}依存性をボルツマン分布を用いて求めた。

【結果および考察】Si MOSFET の反転層中の移動度において、クーロン散乱によって制限される 移動度(µ_c)は、N_s⁺¹に比例することが知られている。これは、クーロン散乱体が反転層キャリアに よってスクリーニングされる効果による。同様なスクリーニング効果のため、MOS 界面において σ、も小さくなることが Brews のモデルから予想される。図 1(a)は、計算で求めたσ。のエネルギー 分布(実線)とコンダクタンス法で求めた Al₂O₃/GaN 界面におけるσ。のエネルギー分布(赤丸お よび黒丸) である[2]。図中の表記(H₂O, O₃+H₂O)は Al₂O₃ 形成時に用いた酸化材を表している。計 算では、midgapにおいて、 σ_s =8とした。計算で求めたエネルギー分布では、 σ_s は伝導帯に近づ くにつれて、減少することが分かる。これは、先に述べたスクリーニングの影響である。一方、 実験結果では、σ₈は伝導帯端に向けて増加する傾向が見られる。このことは、Al₂O₃/GaN 界面に おける界面準位はアクセプタ型の性質を持っていることを示している。また、界面準位が電子を 捕獲し、その電荷をスクリーニングする効果は小さいことを示している。 MOSFET の動作を考 えた場合、この様な界面特性は大幅にμcを低下させることが予想される。Midgapにおけるσsの大 きさが2と8の場合の N_x 依存性を図1(b)に示す。点線は、midgapにおける σ_x の大きさが8の場合 で、スクリーニング効果が無い場合を示している。σ_s=8の場合、N_sの増加と共に、σ_sは減少する が、 $N_s=1 \times 10^{12} \text{cm}^{-2}$ においても、 $\sigma_s=2$ 程度の揺らぎが存在する。同様に $\sigma_s=2$ の場合においても、 $N_s=1\times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$ において、 $\sigma_s=0.5$ 程度の揺らぎ存在する。計算方法の部分で述べた様に、計算では、 N_{tt} は E_{SF} に依存しないと仮定しているが、図 1(a)で議論した様に、 N_{tt} は E_{c} に近づくに連れて増加 するので(σ_sの大きさは N_iに依存するため)、Fig.1(a)に示した界面特性を有する様な MOS 界面で は、N_s=1×10¹²cm⁻²において、さらにσ_sの値が大きくなると考えられる。これらの結果は、MOSFET 特性の向上のためには、N_{it}だけでなく、界面準位の性質やスクリーニングの効果を考慮すること が重要であることを示している。当日は、移動度とσ。の関係について更に議論する予定である。 【謝辞】この成果は、NEDO より委託を受け実施した。参考文献: 1)S. Takagi et al., IEEE TED, 41, 2357(1994). 2) N. Taoka et al., Jpn. J. Appl. Phys., 57, 01AD04 (2018). 3) J. R. Brews, J. Appl. Phys., 43, 2306 (1972).